

Workshop Microanalysis on FIB-SEMs

Dienstag, 24. November 2015

On the occasion of two new Zeiss Auriga FIB Microanalysis installations at KIT Campus North, we cordially invite you to a workshop discussing methods and practical application of FIB-SEM microanalysis with EBSD, EDX and WDS in materials research.

Agenda: 9:30 Welcome

- 10:00 FIB/REM Serienschritte mit EDX und EBSD am Beispiel von Al-Gusslegierungen, Gusseisen und Elektrowerkstoffen**, Michael Engstler, Universität des Saarlandes
- 10:30 Measurement and analysis of 3D EBSD data**
Stefan Zaefferer, MPIe, Düsseldorf
- 11:00 Tracking of Grain Boundary Movement Due to (Thermo-) Mechanical Deformation**
Stefan Wurster, ESI, Leoben,
- 11:30 Coffee Break**
- 11:45 EBSD and Anisotropic Properties**
Karsten Kunze, ScopeM, ETH Zürich
- 12:15 Evaluation of the Orientation Relationship of Eutectoid FeAl and FeAl₂ using EBSD and FIB**, Alexander Kaufmann, KIT-IAM
- 12:15 State-of-the-art 3D -EDX with a FIB-SEM: What can we expect and where are the limits?**
Marco Cantoni, CIME, EPFL
- 13:00 Lunch**
- 14:00 Laborführungen AWP und INT**
- 15:00 XB540 – A Perfect Characterization Platform for Advanced Analytics**
Peter Gnauck, Applikation Carl Zeiss Microscopy GmbH
- 15:30 t-EBSD**
Rene de Kloe, EDAX Application Specialist
- 16:00 Strain Analysis**
Enrico Bruder, TU Darmstadt
- 16:30 ACOM-STEM im Vergleich mit EBSD**
Christian Kübel, KIT-INT
- 17:00 Abschlussdiskussion (Schluss gegen 17:15)**

Ort: KIT Campus Nord, im Institut für Nanotechnologie (INT - Gebäude 640, Raum 0-167), Hermann-von-Helmholtz Platz 1, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen. Anmeldung unter: www.knmf.kit.edu/604.php

Sponsoren:



Carl Zeiss Microscopy GmbH

